## BIULETYN INSTYTUTU ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA 011 KRAKÓW, ul. Wrocławska 37a, POLAND, tel. +48 12 63 17 333, 63 17 100, fax +48 12 63 39 490, ios@ios.krakow.pl, www.ios.krakow.pl

dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem

## Metody kształtowania materiałów ceramicznych

**Ceramics machining methods** 

### PIOTR PUTYRA MARCIN PODSIADŁO

120

JOLANTA LASZKIEWICZ-ŁUKASIK TADEUSZ KRZYWDA\*

Przedstawiono wyniki badania właściwości fizycznych i mechanicznych ceramiki o osnowie z  $AI_2O_3$ , SiC, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> z dodatkami faz o dobrej przewodności elektrycznej oraz ceramiki o osnowie z TiB<sub>2</sub>. Określono gęstość, moduł Younga, twardość HV1 oraz przewodność elektryczną poszczególnych materiałów. Ceramiczne materiały kompozytowe z fazami przewodzącymi zostały wytworzone z zastosowaniem urządzenia do spiekania metodą SPS (*Spark Plasma Sintering*). Materiały odznaczające się dobrą przewodnością elektryczną kształtowano za pomocą obróbki elektroerozyjnej (EDM – *Electro Discharge Machining*). Powierzchnie materiałów po cięciu elektroerozyjnym poddano analizie z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. SŁOWA KLUCZOWE: materiały ceramiczne, spiekanie SPS, ob-

# róbka elektroerozyjna, EDM

Presented in the paper are physical and mechanical properties of the  $Al_2O_3$ , SiC and  $Si_3N_4$  matrix ceramics with good electrical conductivity phases added and of TiB<sub>2</sub> matrix ceramics. Density, elastic modulus, hardness HV1 and electrical conductivity of each material were determined. Ceramic composite materials with conductive phases have been produced using SPS (Spark Plasma Sintering) method. Materials showing good electrical conductivity were shaped by means of EDM (Electro Discharge Machining) method. Material surfaces as left after EDM cutting were inspected by means of scanning electron microscopy.

KEYWORDS: ceramic materials, spark plasma sintering, electro discharge machining, EDM

Materiały ceramiczne należą do struktur o wiązaniach jonowych lub kowalencyjnych. W odróżnieniu od metali, w przypadku substancji o wiązaniach jonowych lub kowalencyjnych stany energetyczne elektronowych nośników ładunku zdolnych do wywołania przewodzenia prądu (tj. stany należące do pasma przewodnictwa) są puste. Przewodnictwo elektryczne występuje wyłącznie w wyniku wzbudzenia (termicznego lub optycznego) elektronów o niższych stanach energetycznych, przy czym wykonana praca musi mieć większą wartość od wartości energii wzbronionych. Można więc przyjąć, że dla większości materiałów ceramicznych o wiązaniach jonowych i dodatkowo o wysokiej czystości nie występują nośniki ładunków. Właściwości elektryczne polikrystalicznych i wielofazowych materiałów ceramicznych można zmieniać poprzez modyfikację składu i budowy granic międzyziarnowych oraz powierzchni materiałów [1].

Ze względu na właściwości ceramiki technicznej (tlenkowej lub azotkowej) oraz możliwości, jakie daje obróbka elektroerozyjna (EDM), badania zmierzające do zwiększenia przewodności elektrycznej ceramiki technicznej są w pełni uzasadnione i celowe. Materiały ceramiczne na bazie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>, B<sub>4</sub>C oraz Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> odznaczają się bowiem szeregiem korzystnych właściwości mechanicznych (dużą twardością i wytrzymałością w szerokim zakresie temperatur, odpornością na działanie środowiska utleniającego oraz korozyjnego – również w wysokich temperaturach, odpornością na szoki cieplne) i są powszechnie wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Ograniczenia ich zastosowania wynikają z faktu, że elementy kształtowane obróbką szlifowaniem odznaczają się niezbyt skomplikowanym kształtem. Bardziej złożone części ceramiczne można formować obróbką EDM, o ile obrabiany materiał ma odpowiednią przewodność elektryczną.

Wprowadzenie do osnowy naturalnych przewodników TiN, TiC, Ti(C,N) lub TiB<sub>2</sub> poprawia przewodność ceramiki wielofazowej, np. Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-Ti(C,N), ZrO<sub>2</sub>-TiN, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiC<sub>w</sub>-TiC. Umożliwia to przeprowadzenie obróbki EDM takich materiałów, a w efekcie – wykonanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach [2÷6]. Dodatkową zaletą tej metody obróbki jest fakt, że nie wywołuje ona w przedmiocie obrabianym naprężeń mechanicznych. Dlatego może być wykorzystywana do obróbki materiałów ceramicznych niezależnie od ich twardości i wytrzymałości.

W przypadku ceramiki tlenkowej na bazie  $AI_2O_3$  lub  $ZrO_2$ , aby uzyskać przewodność odpowiednią do obróbki EDM, należy wprowadzić do osnowy fazę węglikową bądź azotkową w ilości ok. 30% [7÷9]. Jeśli zaś dodatkiem mającym obniżyć oporność ceramiki tlenkowej jest faza metaliczna, istotne różnice są zauważalne przy nieco niższej zawartości tej fazy. W pracy [10] stwierdzono, że już dodatek 20% obj. Mo do osnowy  $AI_2O_3$  powoduje znaczący wzrost przewodności. Do obróbki EDM nadają się materiały, których oporność jest nie większa niż 100  $\Omega$ ·cm [11, 12]. O ile zostaną zachowane odpowiednie właściwości mechaniczne, zwiększenie udziału fazy węglikowej bądź azotkowej w ceramice o małym przewodnictwie jest uzasadnione, ponieważ podnosi wydajność procesu EDM [13].

#### Kompozyty ceramiczne

Wytworzono kompozyty ceramiczne o osnowie z Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiC i Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> z 30-procentowym dodatkiem faz o dobrej przewodności elektrycznej w postaci TiB<sub>2</sub>, TiC oraz TiN. Dla porównania badaniom poddano również ceramikę o osnowie z TiB<sub>2</sub> z dodatkiem węglika cyrkonu w ilości 14%. W kompozytach o osnowie z azotku krzemu zastosowano dodatki w postaci faz tlenkowych (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO i ZrO<sub>2</sub>), których wprowadzenie miało na celu poprawę spiekalności.

Poszczególne mieszanki przygotowano w wysokoenergetycznym młynku planetarnym Pulverisette 6, przy czym wielkość proszków wsadowych nie przekraczała 3 µm.

<sup>\*</sup> Dr inż. Piotr Putyra (piotr.putyra@ios.krakow.pl), Marcin Podsiadło (marcin.podsiadlo@ios.krakow.pl), mgr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik (jolanta.laszkiewicz@ios.krakow.pl), inż. Tadeusz Krzywda (tadeusz. krzywda@ios.krakow.pl) – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

#### MECHANIK NR 2/2015

Jedynie w przypadku proszku ZrC wielkość ziarna mieściła się w zakresie 3+5 µm. Do sporządzenia mieszanki do kompozytów o osnowie z SiC użyto naczyń mielących i mielników z węglika wolframu, a do pozostałych mieszanek (do wytwarzania kompozytów o osnowie z  $AI_2O_3$ ,  $Si_3N_4$  i  $TiB_2$ ) – mis i kul wykonanych z azotku krzemu. Po zmieleniu mieszanki suszono, a następnie granulowano.

Materiały spiekano metodą SPS w urządzeniu o oznaczeniu FCT HP D 5 (rys. 1). Prasowanie mieszanek proszkowych odbywało się w matrycy grafitowej pod ciśnie-niem maksymalnym 35 MPa, w warunkach próżni. Zastosowanie próżni oraz długotrwałe prasowanie miały na celu odpowietrzenie mieszanki zasypanej do matrycy. Następnie do komory do spiekania wprowadzono gaz ochronny (azot lub argon). Parametry spiekania przedstawiono w tablicy.



Rys. 1. Urządzenie FCT HP D 5 do spiekania metodą SPS (a); komora do spiekania (b)

CNC. Mikrostrukturę powierzchni materiałów po przecinaniu elektroerozyjnym analizowano skaningowym mikroskopem elektronowym JSM-6460 LV firmy JEOL. Na rys. 2 i 3 przedstawiono profile powierzchni po cięciu elektroerozyjnym materiałów o osnowie z SiC, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> oraz TiB<sub>2</sub>. W opisie zdjęć umieszczono dodatkowo wartość parametru f określającego prędkość cięcia.



prędkość cięcia EDM f = 2 mm/min prędkość cięcia EDM f = 2 mm/minRys. 2. Mikrostruktura i profile powierzchni po przecinaniu elektroerozyjnym materiałów: a) SiC-TiB<sub>2</sub>, b) SiC-TiC



prędkość cięcia EDM f = 6,5 mm/minprędkość cięcia EDM f = 2 mm/minRys. 3. Mikrostruktura i profile powierzchni po przecinaniu elektroerozyjnym materiałów: a) Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-TiB<sub>2</sub>, b) TiB<sub>2</sub>-ZrC

podstawie przeprowadzonych badań właściwości fizycznych i mechanicznych oraz wyników prób cięcia

elektroerozyjnego do kolejnych procesów obróbki EDM wytypowano następujące materiały: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Ti(C,N)-TiB<sub>2</sub> oraz Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-TiB<sub>2</sub>. Tymi procesami były: elektroerozyjne wyrównanie powierzchni próbek wirującą elektrodą oraz elektroerozyjne drążenie otworów. Przeprowadzono je na drażarce o oznaczeniu EDEE40 CNC (produkcji IZTW).

W przypadku wyrównywania powierzchni wirującą elektrodą grafitową uzyskano płasko-równoległość próbek mieszczącą się w granicach 0,02 mm. Proces drążenia przeprowadzano dwuetapowo: wykonano wstępne drążenie kształtujące oraz drążenie wymiarowe.

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> oraz TiB<sub>2</sub> Parametry Moduł Twardość Gęstość Oporność spiekani względna HV1 Younga Materiał (temperatura/czas) % GPa °C/min Ω

TABLICA. Wybrane właściwości materiałów kompozytowych o osnowie z Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiC,

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Ti(C,N) + TiB<sub>2</sub> 1650/1 96,6 392 2106 1,35.10-2 2000/0.5 SiC + TiB<sub>2</sub> 419 2100 < 1 95 1800/15 1900/60 SiC + TiC 287 1500 <1 81  $Si_3N_4 + TiB_2$ 1550/10 92 318 1920 8 45 10-1 2000/10 493 2,66.10-2 TiB<sub>2</sub> + ZrC 96 2240

Badania zrealizowano na próbkach, których powierzchnie przygotowano urządzeniami firmy Struers. Gęstość pozorną  $\rho_{p}$  mierzono metodą nasycania w próżni. Twardość przy obciążeniu 9,81 N wyznaczono metodą Vickersa za pomocą cyfrowego miernika mikrotwardości FM-7 firmy Future-Tech Corp. Przeprowadzono również pomiary modułu Younga ultradźwiękową metodą pomiaru prędkości przechodzenia fali poprzecznej i podłużnej z wykorzystaniem defektoskopu Panametrics Epoch III. Pomiar oporności wykonano technicznymi mostkami Wheatstone'a (typ MMW-5) oraz Thomsona (TMT-5). Właściwości fizyczne oraz mechaniczne materiałów po spiekaniu zestawiono w tablicy.

### Obróbka EDM materiałów ceramicznych

W celu potwierdzenia możliwości zastosowania obróbki EDM do kształtowania kompozytowych materiałów ceramicznych przeprowadzono próby cięcia na obrabiarce EWEB40S





Rys. 4. Elementy z ceramiki przewodzacej po procesach elektroerozyjnych: a) wyrównywaniu powierzchni, b) drążeniu, c) przecinaniu





Na ostatnim etapie użyto profilowanej elektrody miedzianej. Przykładowe elementy wykonane z wytworzonych materiałów ceramicznych po kształtowaniu elektroerozyjnym przedstawiono na rys. 4.

### Podsumowanie

Większość materiałów ceramicznych odznacza się wysoką opornością elektryczną, co powoduje, że kształtowanie gotowych elementów z tych materiałów jest możliwe jedynie przez obróbkę ubytkową (głównie przecinanie i szlifowanie). Niestety, tą metodą otrzymuje się detale o nieskomplikowanym kształcie. Natomiast elementy ceramiczne o zróżnicowanych formach wykonuje się za pomocą obróbki EDM, przy założeniu że obrabiany materiał ma odpowiednią przewodność elektryczną. Rezystywność materiałów ceramicznych można obniżyć przez dodanie faz o dobrej przewodności elektrycznej.

Zaprezentowano wyniki badań materiałów ceramicznych o osnowie z Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiC i Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, do których zastosowano dodatki w postaci TiC lub TiB<sub>2</sub>. Przedstawiono także właściwości mechaniczne i elektryczne ceramiki przewodzącej o osnowie z TiB<sub>2</sub>. Wytworzone materiały kompozytowe charakteryzują się niską opornością elektryczną z zachowaniem bardzo dobrych właściwości fizycznych i mechanicznych, takich jak: gęstość, moduł Younga i twardość. Wprowadzenie faz o wysokiej przewodności elektrycznej do ceramiki umożliwia jej kształtowanie w technologii elektroerozyjnej, np. przez przecinanie i drążenie.

#### LITERATURA

- Pampuch R., Błazewicz S., Górny G. "Materiały ceramiczne dla elektroniki". Kraków: Wydawnictwa AGH, 1993.
- Chen S.L., Hsu Q.C. "Studies on electric-discharge machining of non-contact seal face grooves". *Journal of Materials Processing Technology*. No. 140 (2003).
- Tomlinson W.J., Jupe K.N. "Strength and microstructure of electrodischarge-machined titanium diboride". *Journal of Materials Science Letters*. No. 12 (1993).
- Liu K., Peirs J., Ferraris E., Lauwers B., Reynaerts D. "Micro Electrical Discharge Machining of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-based Ceramic Composites", http://www.4m-net.org/files/papers/4M2008/05-03/05-03.PDF
- Manoj Kumar B.V., Ramkumar J., Bikramjit Basu, Kang S. "Electrodischarge machining performance of TiCN-based cermets". *International Journal of Refractory Metals & Hard Materials*. No. 25 (2007).
- Sanchez J.A., Cabanes I., Lopez de Lacalle L.N., Lamikiz A. "Development of Optimum Electrodischarge Machining Technology for Advanced Ceramics". *The Internation Journal of Advanced Manufacturing Technology*. No. 18 (2001).
- Lauwers B., Liu W., Kruth J.P., Vleugels J., Jiang D., Van der Biest O. "Wire EDM machining of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, ZrO<sub>2</sub> and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-based ceramics". *International Journal of Electrical Machining*. No. 10 (January 2005).
- Lauwers B., Kruth J.P., Liu W., Eeraerts W., Schacht B., Bleys P. "Investigation of material removal mechanisms in EDM of composite ceramic materials". *Journal of Materials Processing Technology*. No. 149 (2004).
- Yan-Cherng Lin, A-Cheng Wang, Der-An Wang, Chih-Cherng Chen. "Machining Performance and Optimizing Machining Parameters of Al2O3–TiC Ceramics Using EDM Based on the Taguchi Method". *Materials and Manufacturing Processes*. No. 24 (2009).
- Hussain S., Barbariol I., Roitti S., Sbaizero O. "Electrical conductivity of an insulator matrix (alumina) and conductor particle (molybdenum) composites". *Journal of the European Ceramic Society*. Vol. 23, Iss. 2 (February 2003).
- Shuichi Kawano, Junichi Takahashi, Shiro Shimada "Highly electroconductive TiN/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composite ceramics fabricated by spark plasma sintering of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> particles with a nano-sized TiN coating". *Journal of Materials Chemistry*. No. 12 (2002).
- Oczoś K.E. "Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych". Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1996.
- Chien-Cheng Liu, Jow-Lay Huang. "Effect of the electrical discharge machining on strength and reliability of TiN/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites". *Ceramics International*. Vol. 29, Iss. 6 (2003).

122